

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0043

Internationale Norm: ISO/IEC 17025:2017
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17025:2018

OST – Ostschweizer
 Fachhochschule
 Institut für Mikrotechnik
 und Photonik (IMP) -
 Kompetenzzentrum
 Produktionsmesstechnik
 Werdenbergstrasse 4
 9471 Buchs SG
 Schweiz

Leiter: Michael Marxer
 MS-Verantwortlicher: Christoph Battaglia
 Telefon: +41 58 755 33 39
 E-Mail: michael.marxer@ost.ch
 Internet: <http://www.ost.ch/pmt>
 Erstmals akkreditiert: 09.11.1992
 Aktuelle Akkreditierung: 07.03.2022 bis 06.03.2027
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 07.03.2022

Kalibrierlaboratorium für Rauheit und dimensionale Grössen

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit \pm ¹⁾	Bemerkungen
Rauheit				
Ra, Rq	0,05 μm ... 12,5 μm	Messstrecke $l_n = 5 \lambda_c$ $\lambda_c = 0,8 \text{ mm}$	$(0.004 + 0.02 \times R) \mu\text{m}$	Anzahl Messstellen ≥ 12 über die Messfläche verteilt.
Rp, Rv	0,10 μm ... 60,0 μm		$(0.015 + 0.04 \times R) \mu\text{m}$	
Rz, Rt	0,20 μm ... 120,0 μm		$(0.030 + 0.04 \times R) \mu\text{m}$ R gemessener Rauheitswert / μm	Eine Umwertung auf andere Rauheitsparameter ist nicht gestattet.

SCS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SCS 0043

Messgrösse / Kalibriergegenstand	Messbereich	Messbedingungen	Bestmögliche Messunsicherheit ± ¹⁾	Bemerkungen
Lehren und Referenzkörper	(1200 x 1000 x 700) mm ³	KMG Taktile Messung	Bezogen auf eine Merkmalgrösse von 100 mm	Kalibrierung mittels Koordinatenmessgeräten Messunsicherheitsabschätzung nach VDI 2617 Blatt 11
	(600 x 650 x 400) mm ³	KMG Optische Messung		
Grössenmasse				
Durchmesser			0,3 µm	SN EN ISO 14405
Abstand			0,3 µm	SN EN ISO 14405
Winkel			0,00023°	SN EN ISO 14405
Form				
Rundheit			0,5 µm	SN EN ISO 1101
Zylindrizität			0,5 µm	SN EN ISO 12181
Geradheit			0,3 µm	SN EN ISO 12180
Ebenheit			0,4 µm	SN EN ISO 12780
Sphärizität			0,8 µm	SN EN ISO 12781
Richtung				
Rechtwinkligkeit			0,5 µm	SN EN ISO 1101
Parallelität			0,5 µm	SN EN ISO 1101
Neigung			0,5 µm	SN EN ISO 1101
Ort				
Position			0,3 µm	SN EN ISO 1101/5458
Koaxialität			0,1 µm	SN EN ISO 1101
Lauf				
Rundlauf			0,5 µm	SN EN ISO 1101
Planlauf			0,6 µm	SN EN ISO 1101

* / * / * / * / *

(1) Die angegebene erweiterte Messunsicherheit ist die Standardunsicherheit der Messung multipliziert mit einem Erweiterungsfaktor k = 2, was für eine Normalverteilung einem Vertrauensniveau von etwa 95 % entspricht.